当研究所(略:F3D)の装置は、大学・公的機関、企業に所属の方の利用が可能です。 当研究所HP内で、以下3点をご確認ください。

・装置一覧

#### ・装置利用料金

・大阪大学 F3D 実装協働研究所の利用ならびに利用料金に関する規程

利用方法は①依頼利用と②自主利用の2種類からお選びいただけます。

利用を希望する方は、メール、電話、またはご来所で、利用したい装置・評価項目等を F3D にお知らせください。F3D スタッフが内容を確認し、最適な利用方法を提案します。

利用申請書を提出していただき、当研究所内で審査を行い、利用許可の可否をご連絡いたします。

<装置利用の流れ>



①依頼利用:お客様のサンプルをお預かりし、当研究所のスタッフがご希望の評価項目を実施し、結果を報告いたします。必要に応じ報告書を発行いたします。

②自主利用:一部の装置を除き、お客様がご自身で装置を操作し、測定等を行います。

③年間一括利用(パスポート):使用頻度の高いお客様には年間 200 万円(税別)・400 万円(税別)の年間一括 利用制を用意しています。お問い合わせください。

④利用申請書(一般用)を提出:メール(<u>f3d@sanken.osaka-u.ac.jp</u>)、または FAX(06-6879-8488)にてご提出ください。利用の許可が下りましたら、次の来所時、原本をご提出ください。

⑥装置利用:申請書をご提出いただき、当研究所での審査を経て、使用許可についての結果をご連絡いたします。 利用の許可が下りましたら、初回講習会を受けていただきます。スタッフから使用上の注意など説明を受けた後、 装置利用が可能になります。使用後は原状回復をお願い申し上げます。故障、不具合があった場合、速やかに近 くのスタッフにご報告願います。誤った操作等によって装置に損害を与えた場合、請求させていただくことがあ ります。キャンセルについては、前日午後5時までにご連絡ください。当日のキャンセルの場合は、当日予約分 の料金を請求いたします。

詳細は大阪大学 F3D 実装協働研究所の利用ならびに利用料金に関する規程をご覧ください。

(大学連携研究設備ネットワーク) https://chem-eqnet.ims.ac.jp/

外部の大学連携研究設備ネットワーク HP を通じて予約していただきます。

登録の流れは下記をご参照しください。ユーザーID を取得した上、装置予約にお進みください。

\*大学・公的機関の方は所属機関が登録済の場合があります。

登録・未登録の確認は https://chem-eqnet.ims.ac.jp/terms/access/organizations.html でお願いします。



上のページのフローチャート内リンクになります。

⑧機関登録申請書:https://chem-eqnet.ims.ac.jp/regist\_org2%282020.08.11%29.docx

⑨研究室・会計責任者登録申請書: https://chem-eqnet.ims.ac.jp/regist\_lab%2Bkaikei%20%282019.09.27%29.xlsx ⑦大学連携研設備ネットワーク HP にて装置予約の操作手順

1.	学連携研設備ネットワーク HP ログイン画面 <u>https://eqnet.jp/users/login</u>	
につ	マセスしてください。ユーザーID、パスワードを入力し、ログインしてくださ	°ر ۴

大学連携研究設備ネットワーク
インフィンア約・課金システム ログアウトしました。
ユーザーID /(スワード > ID//(スワードをお忘れの方
ログイン
日本語(JP) English(US)

<u>「予約」→「設備を検索」をクリック</u>します。

大学連携研究設備ネットワークマイページ	予約 予約状況	課金状況	
お気に入り	設備を検索		
┏ クリックすると「設備を検索」 画面へジ・	お気に入り		
₿ 最新の情報に更新	よく使う設備		
設備		カテゴリ	設備所属

# 3. キーワード欄に予約したい<u>装置番号(例:I-201-03</u>)を入れて、「検索」をクリックします。

大学連携研究設備ネットワーク	伏況 課金状況	2			〇 日本語(.	JP) 🗸	利用者
設備をや::::		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				לו	レンダー
≠- <u>1</u> -⊧ <mark>≥ I-201-03</mark>		● OR檢索 〇 AND檢索 Q 檢索 ④	クリア				
▲ 詳細な検索条件を閉じる							
地域 全て 💛 機関 全て		・         部局         全て         ・					
カテゴリ 全て 🖌 全て		×					
利用受付 🗌 相互利用予約 🗌 依頼測定予約 🗌 どちらでも可							
公開範囲 🗌 国 📄 🍟 🗌 🏦 🔛 紹介の	りみの設備を表示す	ta 🚯					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				1ページあたり	20 > 件を表示	〒 1485 件中 1	作から
設備	公開範囲	カテゴリ	設備所属	設備管理者	利用資格	相互利用	依頼》
400MHZ 核磁気共鳴装置 (日本電子(株)・JNM-ECS型)	国学企	核磁気共鳴装置(NMR)-400MHz NMR装置	北海道大学 工学研究院	大熊 毅	-	0	
400MHZ 核磁気共鳴装置 (日本電子(株)・JNM-ECX型)	国学企	核磁気共鳴装置(NMR)-400MHz NMR装置	北海道大学 工学研究院	大熊 毅	-	0	
400MHZ 核磁気共鳴装置 (日本電子(株)・JNM-LA型)	国学企	核磁気共鳴装置(NMR)-400MHz NMR装置	北海道大学 工学研究院	大熊 毅	-	×	
<u>600MHz 核磁気共明装置 (ブルカー(株)・Avance)</u>	国学企	核磁気共鳴装置(NMR)-600MHz NMR装置	北海道大学 理学研究院 化学部門物理化学分野 構造化学研究室	石森浩一郎	-	0	
核磁気共鳴装置 (日本電子ECX-400-1)	国学企	核磁気共鳴装置(NMR)-400MHz NMR装置	北海道大学 触媒科学研究所	ユーザー1	-	0	
重界放射型透過型電子顕微鏡(日本電子JEM-2100F)	国学企	電子顕微鏡および関連機器-透過型電子顕微鏡 (TEM)	北海道大学 触媒科学研究所	清水研一	必要	0	
<u>FTNMR装置</u>	国学企	核磁気共鳴装置(NMR)-270MHz NMR装置	北海道教育大学 教育学部・函館校	中村秀夫	-	0	
吸着量測定装置	国学企	専用測定装置・比表面積/細孔分布(ボロシメータ、吸着料測定)	北海道教育大学 教育学部・函館校	松橋博美	-	0	
粉末X線回折装置 (RIGAKU·ULTIMA IV)	国学企	構造解析/元素分析-粉末・薄膜X線回折、小角散乱(XRD, SAXS)	北海道教育大学 教育学部・函館校	松橋博美	-	0	
電子スピン共鳴装置 (JEOL・)	国学企	構造解析/元素分析・電子スピン共鳴装置(ESR)	北海道教育大学 教育学部・函館校	中村秀夫	-	x	
電子スピン共鳴装置 (JEOL・)	国学企	構造解析/元素分析・電子スピン共鳴装置(ESR)	北海道教育大学 教育学部・函館校	中村秀夫	-	x	
		#535年半週注意(NIND) 2008日~NIND注意	<del>√2 100 T ass 4-46</del> T 466 <u>∆</u> 7	00 -7 25		~	

# 4. 予約したい装置が出てきます。「装置名」をクリックします。

大学連携研究	設備ネットワーク	マイページ	予約	予約状況	課金状況							
設備を検索												
キーワード	I-201-03						● OR検索		ID検索	Q 検索	💁 クリア	
▲ 詳細なれ	検索条件を閉じる											
地域	全て	~	機関全て			~	部局全	τ		~		
カテゴリ	全て		<ul><li></li></ul>						~			
利用受付	🗌 相互利用予約	🗌 依頼測定予	約 🗌 どちら	でも可								
公開範囲	□国□学	É 🗆 <u></u>	C	] 紹介のみの言	没備を表示する	5 🔒						
$\bigcirc\bigcirc$	1											
設備				公開	間範囲 た	ヮテゴリ					設備所属	
"スパック装置	置 <u>(E-200S)"</u>			国	学企成	〕. 読・蒸着・	膜厚測定-真空	蒸着・スパッ	夕(vac. coate	er • Sputter)	大阪大学 A 3D実装協	<sup>全業科学研</sup> 働研究所

5. 自主測定の場合は<u>「相互利用予約」</u>を、依頼測定の場合は<u>「依頼測定予約」をクリック</u>してください。 自主測定の方は次の6をご覧ください。依頼測定の方は次の7をご覧ください。

大学連携研究設備ネットワーク	マイページ	予約	予約状況	課金状況							
設備詳細											
					≣ル牌						
äx vii											
					設備 "スパッタ装置(E-200S)" ^						
					▼						
				設備二	□-F S-NK-OSU-ISI-F3D-F3D-031						
				カラ	テゴリ 成膜・蒸着・膜厚測定						
					真空蒸着・スパッタ(vac. coater・Sputter)						
					仕様 高真空中のプロセスチャンパーに設置された3種類のターゲットで試料上に成膜をして行く装置です。     基板ホレダーサイズがφ200mmと大きい。また基板ホレダーは加熱・冷却システムを有しているので基     板加込状能でスパッタケロ能です。						
					・ターゲット 3種類装善可						
				設備	篇所属 大阪大学 産業科学研究所 フレキシブル 3 D実装協働研究所 フレキシブル 3 D実装協働研究所						
				設備管	<b>管理者</b> 陳 伝トウ 管理者にメール						
				紹介	<b>ስ</b> ወみ						
利用受付					用受付 🛛 相互利用予約 🖓 依賴測定予約	☑ 相互利用予約 ☑ 依赖测定予約					
備考					備考 I-201-3, I-201-03	I-201-3, I-201-03					
				<b>/\8</b>	اد. ۱۹۹۹						
				ZAB.							
				公明新闻							
				加用地的	四號 5						
				予算	算措置						
				予算措置	置詳細						
					<b>* *</b>						
				簡易予約ペー	->URL ↔ 相互利用予約 《 戻る						

#### 6. 自主測定の予約画面です。

緑の枠に予約内容を記入しましたら、「登録」をクリックしてください。

「登録が完了しました」の画面が出ましたら、操作完了です。

当研究所でスケジュールを確認した上、予約確認メールを送信いたします。予約確認メールが届きましたら、 予約完了となります。当日ご来所ください。



### 7. 依頼測定の予約画面です。

緑の枠の中の必要項目や連絡事項を入力し、「登録」をクリックしてください。 「登録を実行します」の画面が出てきます。「OK」をクリックし、続行してください。 「登録が完了しました」の画面が出ましたら、操作完了です。 当研究所で内容を確認した上、ご連絡いたします。

大学連携研究設備ネットワーク	マイページ	予約	予約状況	課金状況								
依賴測定予約												
							設	備				
			設備ニュースはありません									
			利用者									
			依頼内容									
				希望》	定日*							
			)	通信欄-設備管理	理者宛							
			利用予算区分*			✓ □ 私書	i <b>0</b> 👝	← 会計責任者様に利用できる予算を 確認してお選びください。				
			サンプル									
			測定するサンプルの情報を記入してください。(任意)									
			9221		Xt							
							+ 追	3 <b>5</b> 0				
							測定	自内容				
			依頼した	い測定内容をス	しかしてく	ださい。(任意)						
			課金夕-	イトル		単価		単位				
							+ 追	动				
							申记	と用紙				
				+		ファイル選択時は、Shiftキーを押しな	がら複数運 「ニ ファー	ま沢することも可能です。 イル				
							禄	* ==>+v>+v>+v>+v>+v>+v+v++v++v++v++v++v++v++				